宛 研究部 材料・プロセスリサーチラボ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分析・試験・調査 依頼書** | | 依頼元No  (任意記入) |  |
| 依頼部署名  ICT開発室プロセスグループ | 担当 (内線: 5568)  土屋 | | 承認（内線: 5525）  木内 |
| 標題  ウエハ上の異物元素分析 | | | |
| 製作番号  VK0207 | 依頼日  2025年1月8日 | | 希望納期  2025年1月10日 |
| 分析・試験・調査内容 (調査内容に加え、背景や経緯も簡潔に記載願います。)  ※調査内容が**防衛情報関係の場合は明記**してください。防衛情報関係の場合、特別防衛秘密に該当するか否かについても記載してください。  ※調査内容が守秘義務契約に関連するなど取り扱いに注意する場合は、その旨を記載してください。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 調査品返却 | 要 | 不要 | | 防衛情報 | 該当  特別防衛 | 非該当 | | 調査品名称  型番 | Siウェハ(YSZ成膜品) | | | 材質 | Si/YSZ | | | 製造年月 | 2024/12/25 | | | 使用期間 |  | |   (1)目的  　成膜後のウェハ上に付着した異物の調査  (2)調査方法  　ウエハ表面と割断したウェハのSEM-EDS分析  　ICT開発室人員立ち会いのもと、  ライン分析をお願いします。  　どこをどのように分析するのか相談して決めたく。 | | | |

※調査品の引き取りを行う場合は速やかにお願いします。